この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

1　「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にＭＣＯの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。

2　「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。

3(a)　「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。

「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。

(b)　「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。

(c)　「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。

(d)　「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。

この注９の物品の所属の決定に当たつては、第85.41項及び第85.42項は、第85.23項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。

10　［略］

号注

［略］

85.01 ～ 85.27		［略］		
85.28		モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。）		
		－陰極線管モニター		
8528.42	000	――第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの		ＮＯ
8528.49		［略］		
		－その他のモニター		
8528.52		――第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの		
	100	―――小売用の包装にしたもの（使用されたものを除く。）		ＮＯ
	900	―――その他のもの		ＮＯ

この注８の物品の所属の決定に当たつては、第85.41項及び第85.42項は、第85.23項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。

9　［同左］

号注

［同左］

85.01 ～ 85.27		［同左］		
85.28		モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。）		
		－陰極線管モニター		
8528.41	000	――第84.71項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの		ＮＯ
8528.49		［同左］		
		－その他のモニター		
8528.51		――第84.71項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの		
	100	―――小売用の包装にしたもの（使用されたものを除く。）		ＮＯ
	900	―――その他のもの		ＮＯ